

開示の要約

多元冷凍サイクル装置

- サブファブ内に設置される機器の設置面積を小さくすることができ、かつ半導体
- 5 デバイス製造装置に冷却媒体を移送するための配管を短くすることができる多元冷凍サイクル装置が開示される。多元冷凍サイクル装置は、半導体デバイス製造装置を冷却するための冷却媒体と熱交換を行う第1冷媒が循環する第1冷凍サイクルと、第1冷媒と熱交換を行う第2冷媒が循環する第2冷凍サイクルを備えており、第1冷凍サイクルの少なくとも一部は、半導体デバイス製造装置が設置されたクリーン
- 10 ルーム内に配置されており、第2冷凍サイクルは、サブファブ内に配置されている。

図1